



## 웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 측정 장치

특허등록번호

10-1318934

특허명

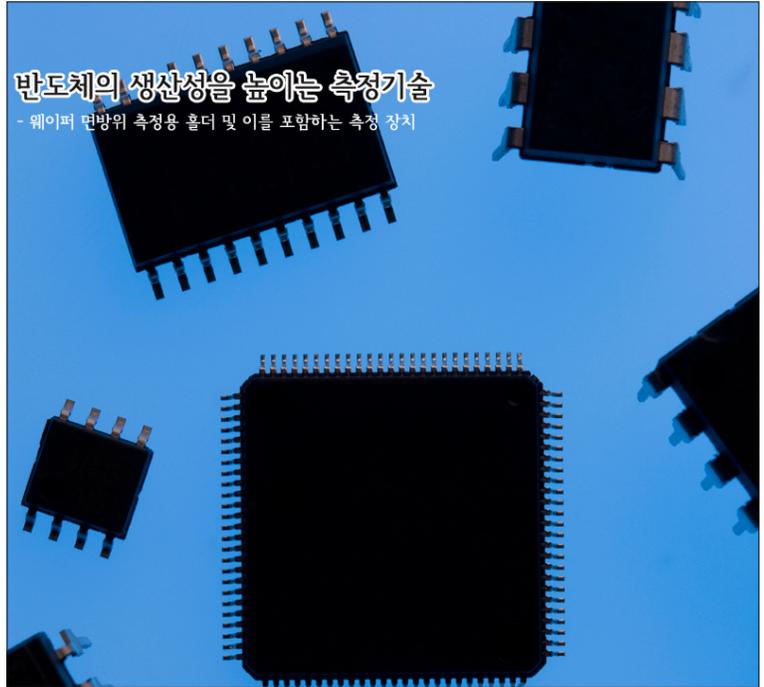
웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 측정 장치

대표발명자

신기능재료표준센터 김창수

### 반도체의 생산성을 높이는 측정기술

- 웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 측정 장치



### 웨이퍼의 상태를 보다 정밀하고 정확하게 측정하는 기술

반도체소자의 재료인 웨이퍼를 보다 정밀하고 정확하게 측정하는 기술을 소개합니다.

해당 기술은 웨이퍼 홀더의 상하 움직임 없이 측정이 가능하며, 웨이퍼의 측정 기준방향을 설정할 수 있을 뿐만 아니라 측정 후 웨이퍼를 회전시켜 추가 측정 또한 가능한 장치 기술입니다.

웨이퍼의 품질을 개선하고 나아가 반도체의 생산성을 향상시켜줄 고마운 기술, KRISS가 함께합니다.

